|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задания СРС 2 микроэлектроника | | | |
|  |  | ФИО студента | оценка |
| 1. Топология микросхем. |  |  |  |
| 1. Тонкие пленки в микроэлектронике. |  |  |  |
| 1. Металлические тонкие пленки в микроэлектронике |  |  |  |
| 1. Диэлектрические тонкие пленки в микроэлектронике |  |  |  |
| 1. Керметные тонкие пленки в микроэлектронике |  |  |  |
| 1. полупроводниковые тонкие пленки в микроэлектронике. |  |  |  |
| 1. Начальные стадии роста пленки. |  |  |  |
| 1. Роль дефектов при росте тонких пленок. |  |  |  |
| 1. Поверхностное сопротивление. |  |  |  |
| 1. Тонкопленочные резисторы в микроэлектронике. |  |  |  |
| 1. Тонкопленочные конденсаторы в микроэлектронике. |  |  |  |
| 1. Аморфный кремний в микроэлектронике |  |  |  |
| 1. Аморфный селен |  |  |  |
| 1. Тонопленочные антиотражающие покрытия |  |  |  |
| 1. Поликристаллические материалы в современной микроэлектронике |  |  |  |
| 1. Нанокристаллические материалы в современной микроэлектронике |  |  |  |
| 1. Аморфные тонкопленочные материалы в современной микроэлектронике. |  |  |  |
| 1. Технология тонких пленок в микроэлектронике. |  |  |  |
| 1. Термическое вакуумное испарение. |  |  |  |
| 1. Электронно-лучевое испарение в вакууме. |  |  |  |
| 1. Молекулярно-лучевая эпитаксия. |  |  |  |
| 1. Многослойные пленки в микроэлектронике. |  |  |  |
| 1. Газовый разряд в технологии напыления пленок. |  |  |  |
| 1. Катодное распыление на постоянном токе. |  |  |  |
| 1. Магнетронное распыление на постоянном токе. |  |  |  |
| 1. СВЧ магнетронное распыление. |  |  |  |
| 1. Промышленная установка магнетронного напыления. |  |  |  |
| 1. Технологический маршрут изготовления микросхем. |  |  |  |
| 1. Технологический маршрут изготовления резистора. |  |  |  |
| 1. Технологический маршрут изготовления тонкопленочного конденсатора. |  |  |  |
| 1. Технологический маршрут изготовления полевого транзистора. |  |  |  |